

Virtual-Reactor CVI SiC edition Version 7.5.1

新しいエディションのご案内

Virtual Reactor は気相からのバルク結晶およびエピ成長シミュレーションソフトウェアです。各種バルク結晶成長方法および結晶種に対応しており、リアクター内の温度分布、対流パターン、各種成分濃度分布、成長速度分布等を求めることができます。

概要

VRT-CVI_SiC Edition は化学蒸気浸透法 (Chemical Vapor Infiltration) による SiC セラミックスの生成モデリングを行います。

本ソフトウェアは以下の現象のシミュレーションが可能です。

- ・MTS (CH_3SiCl_3)、 H_2 、 HCl を含む多成分混合ガスの輸送
- ・リアクター内の熱輸送
- ・多孔性基質内での化学反応 (表面反応)
- ・基質材の浸透 (充填) による多孔性基質の経時変化
- ・成長中の多孔性基質の諸特性値 (空隙率など) の経時変化

